

Mecanismul și rolul factorului cuantic în procesul de difuzie stimulată de fotoni a Zn în GaAs și InP

Sergiu Șișianu

Universitatea Tehnică a Moldovei

Catedra Microelectronica și Dispozitive cu Semiconductor,

Abstract

În lucrare se propune modelul fizico-matematic în baza căruia sunt analizate și calculate dependența coeficientului de difuziune stimulată de fotoni $D(\lambda)$ a Zn în GaAs.

Datele calculate corespund celor experimentale și arată că coeficientul de difuziune stimulată de fotoni crește odată cu creșterea energiei cuantice ori cu micșorarea lungimii de undă a luminii.

Rezultatele obținute pot fi utilizate pentru optimizarea proceselor tehnologice cu tratamentul fototermic rapid de obținere a joncțiunilor p-n, inclusiv a celulelor fotovoltaice în baza semiconductorilor.

1. Introducere.

Conform datelor experimentale, prezentate în [1], coeficientul de difuzie stimulată de fotoni RPD a Zn în GaAs și InP este de 10-100 de ori mai mare comparativ cu difuzia convențională în sobele termice. Iar mecanismul difuziei și profilurile de concentrație $N(x,t)$ sunt complicate și nu corespund funcțiilor $\text{erfc}Z$ ori $\text{erfc}cZ$. [2-4]. Aceste rezultate sunt explicate în baza mecanismului disociativ cu coeficientul de difuziune dependent de concentrație $D(N)$, pe de o parte, și de concentrație $D(N)$, pe de altă parte, de lungimea de undă a luminii $D(\lambda)$, pe de altă parte [5,6]. În literatură sunt discutate unele modele și interpretări ale rolului factorului cuantic al luminii în procesul de difuziune a impurităților în semiconductori [1,4, 7-9]. Însă nu sunt modele în baza cărora pot fi analizate efectele spectrale și dependența coeficientului de difuziune de energia cuantică și de lungimea de undă a luminii.

Scopul acestei lucrări constă în elaborarea modelului pentru calculul dependenței coeficientului de difuzie a impurităților în semiconductori în procesul tratamentului fototermic.

2. Modelul și calculul dependenței coeficientului de difuziune de lungimea de undă a luminii, $D(\lambda)$

Pentru calculul dependenței coeficientului de difuziune de lungimea de undă a luminii, $D(\lambda)$, se propune modelul cu următoarea ecuație:

$$D(T, h\nu) = D_0 \exp[-(E_D - \eta(E_{hv} - E_g))/kT] = \\ = D_0 \exp[-(E_D - \eta E_{hv}(1 - E_g/E_{hv}))]/kT = D_0 \exp[-(E_D - E^*)]/kT, \quad (1)$$

$$E^* = \eta E_{hv}(1 - E_g/E_{hv}), \quad (2)$$

unde D_0 and E_D sunt parametrii difuziei convenționale în sobă termică, E_g este energia benzii interzise a semiconductorului; k – constanta Boltzmann, T – temperatura în °K, $E_{hv} = h\nu = 1,24/\lambda$ – energia cuantului, λ – lungimea undei de lumină.

În ecuația (2) componenta E^* este energia cuantică activă a spectrului de lumină cu valoarea cuantului mai mare de cât energia benzii interzise a semiconductorului, în cazul nostru GaAs ($E_{hv} > E_g = 1,42\text{ eV}$, $\eta\% = 10\%, 20\%, 30\%, 40\%$ și 50%).

Calculele au fost efectuate pentru Zn în GaAs cu următorii parametri: $D_0 = 23 \text{ cm/sec}$, $E_D = 2,5 \text{ eV}$, $E_g = 1,42\text{eV}$, $\eta\% = 10\%, 20\%, 30\%, 40\%$ și 50% . Rezultatele calculelor în baza ecuației (4) sunt prezentate în Tabelul 1.

Tabelul 1. Valorile coeficientului de difuzie RPD a Zn în GaAs, calculate în baza ecuației (4).

$\lambda, \mu\text{m}$		0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,3	0,2
$\eta\% = 10\%$,	$E^*, \text{eV}, \times 10$	0,13	0,35	0,55	1,06	1,86	2,71	4,68
	$D(\lambda), \text{cm}^2/\text{sec}$	$4,7 \times 10^{-10}$	$5,8 \times 10^{-10}$	$7,1 \times 10^{-10}$	$1,0 \times 10^{-9}$	$2,2 \times 10^{-9}$	$5,9 \times 10^{-9}$	$4,7 \times 10^{-8}$
$\eta\% = 20\%$,	E^*, eV	0,26	0,70	1,10	2,12	3,72	5,42	9,36
	$D(\lambda), \text{cm}^2/\text{sec}$	$5,3 \times 10^{-10}$	$9,8 \times 10^{-10}$	$1,2 \times 10^{-9}$	$3,3 \times 10^{-9}$	$1,1 \times 10^{-8}$	$8,8 \times 10^{-8}$	$5,5 \times 10^{-6}$
$\eta\% = 30\%$,	E^*, eV	0,39	1,05	1,65	3,18	5,58	7,13	12,2
	$D(\lambda), \text{cm}^2/\text{sec}$	$6,1 \times 10^{-10}$	$1,2 \times 10^{-9}$	$2,1 \times 10^{-9}$	$9,9 \times 10^{-9}$	$6,1 \times 10^{-8}$	$1,3 \times 10^{-6}$	-
$\eta\% = 40\%$,	E^*, eV	0,52	1,40	2,20	4,24	7,44	10,8	-
	$D(\lambda), \text{cm}^2/\text{sec}$	$6,9 \times 10^{-10}$	$1,7 \times 10^{-9}$	$3,7 \times 10^{-9}$	$2,7 \times 10^{-8}$	$3,3 \times 10^{-7}$	$1,8 \times 10^{-5}$	-
$\eta\% = 50\%$,	E^*, eV	0,65	1,75	2,75	5,30	9,3	13,5	-
	$D(\lambda), \text{cm}^2/\text{sec}$	$9,9 \times 10^{-10}$	$2,3 \times 10^{-9}$	$6,2 \times 10^{-9}$	$9,9 \times 10^{-8}$	$1,6 \times 10^{-6}$	-	-

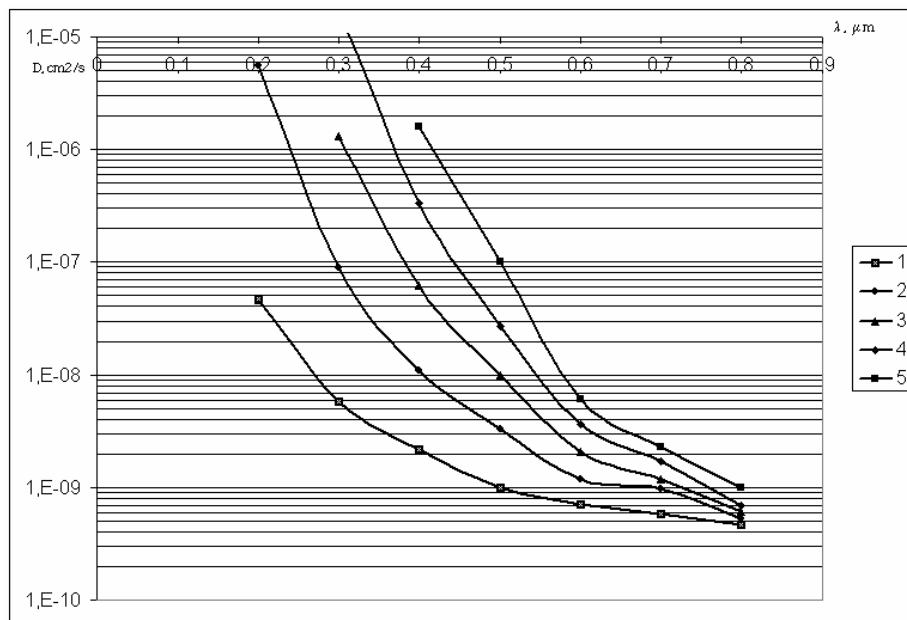


Fig.1. Dependența coeficientului de difuzie RPD a Zn în GaAs de lungimea de undă a luminii, $D=f(\lambda)$ În baza datelor din Tabelul 11 au fost construite graficele dependenței coeficientului de difuzie RPD a Zn în GaAs ca funcție de lungimea de undă, $D=f(\lambda)$, prezentate în fig. 1.

După cum se vede din aceste grafice, valorile coeficientului de difuziune, calculate în baza modelului propus, cresc odată cu descreșterea lungimii de undă de la $\lambda=0,8\mu\text{m}$ până la $\lambda=0,3\mu\text{m}$ după cum urmează: pentru $\eta\% = 10\%$ coeficientul D crește de la $4,7 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{sec}$ până la $5,9 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{sec}$ (curba 1); pentru $\eta\% = 20\%$ coeficientul D crește de la $5,3 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{sec}$ până la $8,8 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{sec}$ (curba 2); pentru $\eta\% = 30\%$ coeficientul D crește de la $6,1 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{sec}$ până la $1,3 \times 10^{-6} \text{ cm}^2/\text{sec}$.

/sec (curba 3); pentru $\eta\% = 40\%$ coeficientul D crește de la $6,8 \times 10^{-10}$ cm² /sec până la $1,8 \times 10^{-5}$ cm² /sec (curba 4); pentru $\eta\% = 50\%$ această creștere este și mai pronunțată (curba 5).

3. Dependența coeficientului de difuziune RPD a Zn în GaAs de valoarea componentei energiei cuantice a luminii, $D=f(E^*/E_D)$,

În fig.2 sunt prezentate graficele dependenții coeficientului de difuziune RPD a Zn în GaAs de valoarea componentei energiei cuantice, $D=f(E^*/E_D)$, folosind datelor din Tabelul 1..

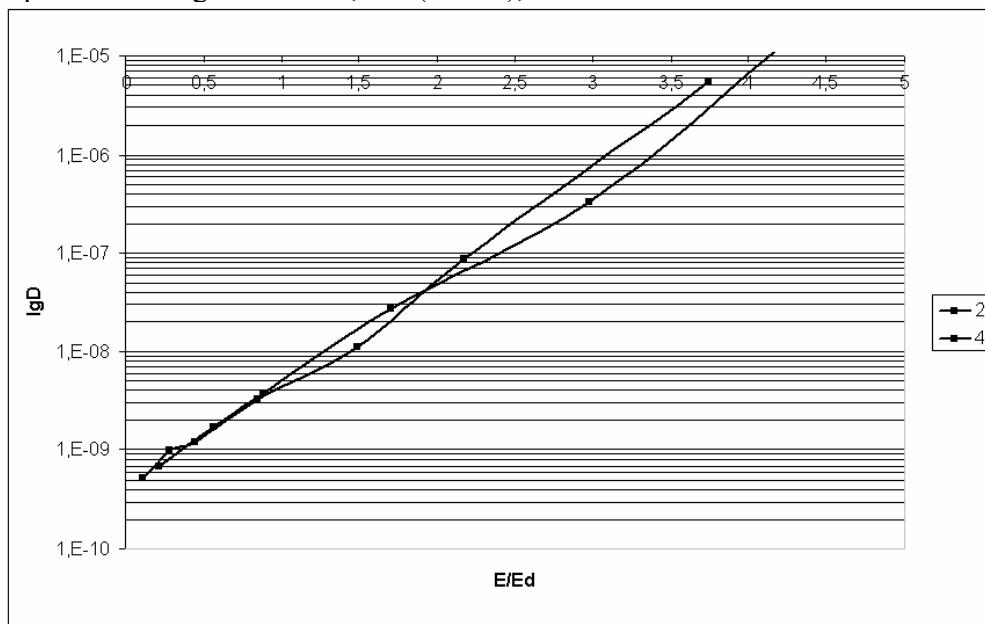


Fig.2. Dependența coeficientului de difuziune RPD a Zn în GaAs de valoarea componentei energiei cuantice a luminii.

Din aceste date se vede că cu creșterea componentei energiei cuantice de la 10% până la 40% valoarea coeficientului de difuziune RPD crește cu câteva ordine în dependență de valorile eficienței ($\eta\%$).

În experiențele noastre au fost utilizate lămpile halogene cu maximumul energiei spectrale situat în intervalul lungimii de undă de la aproximativ $\lambda=1,0\mu\text{m}$ până la $\lambda=0,5\mu\text{m}$, iar eficiența sursei de lumină a fost aproximativ de 20-35%. Pentru aceste condiții, conform datelor din fig. 17 și fig.18, putem obține mărirea coeficientului de difuziune RPD a Zn în GaAs aproximativ de 10-100 de ori, cea ce corespunde datelor experimentale.

Concluzii

A fost elaborat modelul fizico-matematic în baza căruia sunt analizate și calculate dependențele coeficientului de difuziune cu procesarea fototermică rapidă a Zn în GaAs.

Datele calculate corespund celor experimentale și arată că coeficientul de difuziune stimulată de fotonii crește odată cu creșterea energiei cuantice ori cu micșorarea lungimii de undă a luminii.

Rezultatele obținute pot fi utilizate pentru optimizarea proceselor tehnologice cu tratamentul fototermic rapid de obținere a joncțiunilor p-n, inclusiv a celulelor fotovoltaice în baza semiconducțorilor.

Bibliografia

- 1 .Sergiu Șișianu. Tehnologii neconvenționale în microelectronică cu tratament fotonice și difuzie stimulată. Ed. Tehnică, Chișinău – 1998

2. Sergiu Shishyanu, Rajendra Singh, Teodor Shishyanu and Kelvin Poole. Modern and low-cost Technology with Rapid Photothermal Processing for silicon solar cells fabrication. Proc. of 4th International conference Microelectronics and Computer Science, IC MECS-2005, Vol.1, 2005, Chisinau, R. Moldova
3. S. Noel, L. Ventura, A. Slaouni, J.C. Muller, B. Groh, R. Schindler, B. Froeschle and T. Theiler. Optical Effects during Rapid Thermal Diffusion. Journal of Electronic Materials, Vol.27, N_o12, 1998, 1315.
4. R. Singh, M. Fakhruddin, K.F.Poole. Rapid photothermal processing as a semiconductor manufacturing technology for the 21st century. Applied Surface 168, 2000, 198-203.
5. S. Shishyanu. RTP diffusion and junction formation in Si and GaAs. 14st International Conference on Advanced Tharmal Proceeding of Semiconductors – RTP-2006, Japan, 2006, pp.199 -204.

- 6 S. Shishyanu, T. Shishyanu, S. Railean. Shallow p-n junctions formed in silicon used pulsed photon annealing, J. Semiconductors, Vol.36, N5, 2002, pp.581-586. Physics and Tehnic of semiconductors (rus.),
7. D. Lang, L.C. Kimmerling, “Observation of the athermal defect annealing in GaP”, Appl. Phys. Lett.. v.29, N5, pp. 248-250, 1976.
8. B.K. Ridley, “Quantum processing of Materials”, Edit. by C.W.White, P.S.Peercy, AcademicPress-New York, pp.6-19, 1980.
- 9.. LencenkoV.M. Ob aktivatii smescionnoi pri relacsatii electronih vozbujsenii v tverdih telah. FTP,1969, T.3, No11, s. 799-801 (în rusa).
10. Strekalov V.N. Diffuzia v usloviah lazernogo otjiga poluprovodnicov. FTP, 1986,T.20,v.2, (în rusa).